

ランチョンセミナー



参加費無料！お弁当・ドリンク付

参加チケット配付中！
@金属学会・展示会場(1号館1階)

3/9(木) 12:10～12:50

オックスフォード・インストゥルメンツ(株)

C会場 (1号館2階166)

「In-situ加熱実験に対応したEDS/EBSD分析システム」

(株)TSLソリューションズ

E会場 (11号館1階1102)

「EBSDパターンの新たな指標付け法を中心としたOIM-A9 の紹介」(鈴木 清一)

ヴァーダー・サイエンティフィック(株)

I会場 (12号館2階1222)

「大きなサンプルの作製に役立つ装置の紹介」(長沢 浩樹)

3/10(金) 12:10～12:50

(株)島津製作所

E会場 (11号館1階1102)

「超音波光干渉イメージングによる表層欠陥の非破壊検査装置 MIV-Xのご紹介」

ブルカージャパン(株)

G会場 (11号館2階1108)

「ここまで来た！ナノインデンター評価技術！
～環境制御・ハイスループット・in-situ微小力学評価～」(二軒谷 亮)